

ICF与激光等离子体

## 提高腔靶激光能量注入率的新途径

[陈家斌](#) [郑志坚](#) [唐道源](#) [滕浩](#) [丁永坤](#) [陈红素](#) [李雅轩](#)

(中物院核物理与化学研究所, 高温高密度等离子体物理重点实验室, 成都525信箱, 610003)

摘要: 在“星光II”上测量了入射孔边缘镀CH膜的孔靶激光能量注入率, 给出了注入率随入射激光能量和波长变化的经验公式, 同时对堵口现象物理机理进行了一维数值模拟。实验结果表明: 镀CH膜是增加激光能量注入率、提高腔靶辐射温度的有效方法。

关键词: [镀CH膜](#) [激光能量注入率](#) [堵口机理](#) [数值模拟](#)

收稿日期

修回日期

通讯作者

DOI

分类号